科学研究費助成事業

研究成果報告書

	平成	28	年	6	月 3	日現在
機関番号: 8 2 1 1 0						
研究種目: 基盤研究(C)(一般)						
研究期間: 2013~2015						
課題番号: 2 5 3 9 0 1 0 3						
研究課題名(和文)超短パルス軟X線プローブによるフェムト秒レー	ザーアブレー	ション	ン初期	過程	の解明	
研究課題名(英文)A study of the initial process of the femtos	econd laser	ablat	ion b	oy usi	ing the	soft
x-ray laser probe.						
研究代表者 長谷川 登(HASEGAWA, NOBORU)						
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構・原子力科学研究部門	量子ビーム応	用研究	究セン	ター	・研究職	伐
研究者番号:5 0 3 6 0 4 0 9						

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,700,000円

研究成果の概要(和文):高速・微細現象であるため計測が困難であったフェムト秒レーザーアブレーションの初期過 程を「フェムト秒レーザーポンプ・軟X線レーザープローブ装置」を改良することで詳細計測を行った。照射強度がア ブレーション閾値近傍の場合、膨張する表面(Ablation front)から薄膜状の構造体(Expansion front)が放出されるこ とを明らかにした。特に金をサンプルとした場合には、厚さ10ナノメートル以下、面粗さ数ナノメートル以下の極めて 精度の高い薄膜が形成される。更に、実験結果を分子動力学(MD)シミュレーションの指標とすることで、100ピコ秒以 内の初期過程を計算機上で再現することに成功した。

研究成果の概要(英文): We have succeeded in observation of the details of the temporal evolution of the ablating surfaces induced the femto-second laser by using the shingle-shot soft x-ray laser probe system. The ablation front with a solid or the melted surface and the expansion front with thin film structure were observed. Especially the sample of Au, the expansion front separated from the ablation front was thin, dense and smooth, therefore it works as the beam splitter for the soft x-rays at the time within 1 ns after the laser irradiation. The surface roughness of expansion front was better than a few nm, and the formation of nano-bubble structures were expected below the ablation front. In addition we have observed the result of the theoretical simulation for the femtosecond ablation process within 100 ps by using the molecular dynamics (MD) simulation.

研究分野: プラズマ物理

キーワード:フェムト秒レーザー アブレーション 軟X線レーザー 干渉計測 時間分解計測 空間分解計測

1. 研究開始当初の背景

フェムト秒レーザー加工では、特にアブレ ーション閾値強度近傍において明確な閾値 特性が観測されており、加工の制御に繋がる として注目されている[1]。 閾値特性の存在 は、照射強度によってアブレーション過程が 異なる事を示唆しているが、その機構は未だ 明らかにされていない。物理機構の解明には 時間分解計測が不可欠であるが、高速(電 子・原子核の相互作用時間:数十ピコ秒)、 微小(ナノメートル級)な現象であり、更に アブレーションによって生じる表層プラズ マにより可視光領域のプローブは使用困難 となる事から、その計測は困難である。故に 従来では、アブレーションの終状態(クレー ター)の観測と分子動力学(MD)シミュレーシ ョン等が研究の中心であり、それらの直接的 な比較も難しかった。

申請者らは、高強度のプラズマ軟X線レー ザー(SXRL)を用いたプローブ計測手法を開 発することで、フェムト秒レーザー照射金属 表面のアブレーションの時間スケールが照 射強度に極めて敏感である事を示し、またア ブレーション閾値強度近傍でのみ発生する 特異的な現象を観測することに成功してい る。特に「アブレーション閾値近傍強度での ダイナミクス」は、アブレーション機構の解 明に繋がるため、より詳細な計測が求められ ている。

2. 研究の目的

本研究の最終目標は、フェムト秒レーザー 照射におけるアブレーション機構の解明に ある。研究期間内においては、アブレーショ ンの初期過程の時間・空間分解計測を行うた めの「フェムト秒レーザーポンプ・軟X線レ ーザープローブシステム」を整備・改良し、 レーザー照射から数百ピコ秒以内のアブレ ーション閾値強度近傍での初期過程の観測 を行う。更に複数の物質に対する観測及びシ ミュレーションとの比較を行い、アブレーシ ョン機構の解明を目指す。

- 3. 研究の方法
- (1) 軟X線レーザープローブ計測

軟X線は、プラズマに対する透過力が高い 一方で、固体に対する浸透長が数 nm 以下で あることから、プラズマの影響を避けつつ固 体表面の情報を得る事が可能な唯一の波長 領域である(図1)。申請者らは、プラズマ軟 X線レーザー(SXRL)を利用したポンプ・プロ ーブ計測システム(図2)を開発し、研究開 始時点において、深さ方向分解能約1 nm、水 平方向分解能2 μm、時間分解能7 ps での金 属表面のシングルショット計測に成功して いる[2]。図2内のロイズ鏡は軟X線を参照 光と信号光に分割し受光面(CCD)上で重ね 合わせる役割をしており、ミラーの角度の調 整により、干渉計測と非干渉(反射像)計測 を選択可能である。軟X線の反射率は表面形 状(面粗さ)に強く依存している(3 nm の表 面粗さで反射率は約半分になる)ため、反射 像計測は局所的な面粗さの観測に相当する。 本システムでは、軟X線の空間分解計測が可 能であるため、フェムト秒レーザーの照射プ ロファイルをガウス分布とすることで、局所 的な照射強度に対するアブレーション過程 の変化を1ショットで観測することができる。 本システムを用いて、複数の金属(プラチナ、 金、タングステン)を対象として、アブレー ション閾値強度近傍におけるナノメートル 級の表面変位の時間分解計測を行った。





ローブシステム

(2) 分子動力学シミュレーションによるア ブレーション過程の再現

フェムト秒レーザーによるアブレーショ ン過程を再現するために、レーザーからのエ ネルギーの吸収は Lambert-Beer の法則(指 数関数的な吸収)によりエネルギーの空間的 な分布を決定し、各粒子の運動は大規模並列 計算用の分子動力学シミュレーションコー ド LAMMPS[3]をベースに独自のポテンシャル 関数を導入して計算を行った。

4. 研究成果

(1) フェムト秒レーザーアブレーションの 初期過程の観察

サンプルは、照射前の表面状態によるレー ザーの吸収量等の不確定性の影響を避ける ために、厚さ 100 nm の金の蒸着膜を使用し た。アブレーション閾値強度近傍の現象を詳 細に観測するため、照射レーザーの空間分布 はガウス分布(直径 170 μ m、1/e²)とし、1 シ ョットで明確なクレーターが形成される照 射強度(ピーク強度 1.8 J/cm²)とした。図 3 に、アブレーション表面(Ablation front: AF)の干渉像の時間発展を示す。干渉縞 1本 分のシフトは 20 nm の膨張に相当している。 赤い点線は、レーザー照射後に形成されたクレーターのリム構造の位置を示しており、こ の位置での照射強度(1.1 J/cm²)がアブレー ション閾値に相当する。t = 41 ps(図 3(a))で中央部が僅かに膨張を開始しており、t = 230 ps(図 3(b)、(d))では、約 35 nm の膨張及び、周辺部との不連続的な干渉縞のシフトが観測されている。観測された膨張量は、固体から液体への相変化による体積変化(100 nm の厚さに対して約 10 nm)よりも大きいことから、AF の下層ではナノバブルの形成等の密度の減少が生じていると考えられる。しかしながら AF の高さはこの後、縮小に向かうことが干渉計測から観測されている。



図 3. 軟X線干渉像(a)、(b)。クレーターの AFM 像(c)。干渉像から得られた AF の地形(d)。

図 4 に、軟 X 線干渉計の Reference 成分を 除いた、反射像の時間発展を示す。同心円状 の明線が複数観測されており、この同心円の 間隔は中央部に近づくにつれて広くなって おり、また時間の経過と共にその本数も増加 している。これは、AF の上方にドーム状の薄 膜(Expansion front: EF)が形成され、それ ぞれの面からの反射光の干渉により発生し たニュートンリング(図 4(c))であり、図 3(b)においても中央部分にその一部が見ら れている。軟X線領域においてニュートンリ ングが観測されたことは、アブレーション家 庭医において発生した EF が軟X線に対する ビームスプリッターとして機能するほどに 精度が高いことを示している。軟X線の反射 率は面粗さに対して特に敏感であることか ら、ニュートンリングの間隔(1つの間隔が 20 nm の高さに相当) 及び明度の時間変化を 解析することで、EF の形状に加えて、厚み、 密度等の情報も得ることが可能であり、EF は 厚さ 10 nm 以下、面粗さ数 nm 以下、固体密 度の数十%以上の密度を持つ極めて精度の高 い薄膜であることが判明した。この現象は、 レーザーの照射強度に対して敏感であり、ピ ーク強度が 2 J/cm²を越えるとニュートンリ ングは観測されなくなる。



図 4.軟X線反射像(a)、(b)。ニュートンリン グの生成機構(c).

軟X線干渉計測と反射像計測から得られ たアブレーションの初期過程の時間発展を 図5に示す。青線は干渉計測により観測され た AF の高さ、赤点線はニュートンリングか ら得られた量(AF と EF の間隔)、赤線は実際 の EF の高さ(青線+赤点線)を示している。 レーザー照射から約 200 ps 後に AF から EF が分離し、AFの高さは約2 ns まで大きく変 化しないことに対して、EF は約 0.8 ns、高 さ150 nm 程度まで数 nm 以下の面精度を保持 しながら(ニュートンリングが観測される) 膨張する。軟X線のビームスプリッターとし て機能している事から、高密度(固体密度の 数分の1以上)かつ面精度の高い薄膜(膜厚 10 nm 以下) である事が示されているが、そ の質量はクレーター内部の噴出物の僅か 数%程度と見積もられ、またニュートンリン グの輝度が周辺部の輝度と大差ない(微粒子 による軟X線の吸収が少ない)事からも、こ の時間帯では噴出物の大部分はまだ AF 側に



国 S J C W S C C N N J D C C S 図 5. Ablation front (AF)と Expansion front (EF)の時間発展

(2) アブレーションの過程における粒子の噴 出とクレーターの形成

図6はレーザー照射後から125 ns、150 ns 後の軟X線反射像を示している。この時間帯 でのEFは軟X線に対するビームスプリッタ ーとしての機能は喪失しているが、ドーム状 の構造は保持されており、EFを通過した軟X 線の輝度の低下(影絵)として観測されてい る(図中の矢印)。この影は、時間と共に明 度を増しながら画面横方向に膨張すること が確認されていることから、EFの膨張と共に 内部の密度が低下している事を意味してい る。この影を解析することでEF内部の粒子 の総量を見積もる事が可能であり、深さ70 nm のクレーターの質量の半分以上が、EF内部に 充満している事が判明した。従って、この時 点でクレーターの形成はほぼ終了している と言える。EF は照射レーザーのピーク強度が 1.8 J/cm²の場合、 $t = 0.3 \ \mu s$ まで観測され ており、最大高さは 60 μ m に達する。これ らは、ピーク強度に大きく依存しているが、 ニュートンリングの観測の場合と異なり、ピ ーク強度 4.4 J/cm²の場合にも観測されてお り、その場合約1 μ sまで持続し、最大高さ



は 400 µ m にも達する。 図 6. ナノ秒時間帯における EF の計測

今回観測された薄膜状の EF は、他の物質 においても観測されている。金の場合、EF の 形状は照射レーザーの空間プロファイルが ガウス分布であるにも関わらず、ほぼ2次関 数で表される。一方でタングステンの場合で はガウス分布に近い空間プロファイルが観 対的に高く(Au: 1.1 J/cm²、W: 0.3 J/cm²)、 ガウス分布を有する照射レーザー分布の裾 野の照射強度の低い領域がアブレーション に寄与(粒子に運動量を与える)していない ため考えられる.これは EF の形状がレーザ ーの局所的な照射強度に依存している事を 示すと共に、EF の形状制御の可能性を示して いる。

(3)分子動力学シミュレーションとの比較

図7に、吸収されたエネルギー密度を0.024 J/cm²、0.044 J/cm²とした場合の金のアブレ ーションの分子動力学シミュレーションの 結果を示す。金のフェムト秒レーザーに対す る反射率を 98%と仮定するとそれぞれが 1.2 J/cm²、2.2 J/cm² での実験条件に相当する。 図 7 (a) では、厚さ 10 nm 以下の薄膜が構造を 保持しつつ飛翔していることから、この薄膜 が実験における EF に相当し、ニュートンリ ングの発生に寄与していると考えられる。こ れに対して照射強度が2倍程度に相当する図 7 (b)では膜構造が早期に失われており、実 験結果と良い一致が得られている。現象の時 間スケールについても、図7(a)における100 ps 時点での薄膜の飛翔距離は約10 nm であり、 200 ps 時点でニュートンリングが観測され始 める(20 nm の高さに相当)実験結果と良い 一致が得られている。以上から、アブレーシ ョンの初期過程における実験結果を分子動 力学シミュレーションにより再現する事に 成功したと言える。



図 7.分子動力学シミュレーションによる金の アブレーションの再現。(a) 照射強度 1.2 J/cm²相当。(b) 照射強度 2.2 J/cm²相当。

(4)まとめと今後の展望

物質表面の観測に最適な軟X線レーザー プローブを用いる事で、フェムト秒レーザー アブレーション過程の初期過程における特 異的な現象(ナノメートル級の薄膜の形成) を捉える事に成功し、更に、実際にクレータ ーが形成されるナノ秒の時間帯における観 測を行う事で、アブレーション過程の大まか な描像を得ることに成功した(図 8)。更に、 本結果をベンチマークとすることで、t<0.1 nsの時間帯において分子動力学シミュレー ションを用いて実験結果を再現する事に成 功している。今後、シミュレーションとの詳 細な比較を行う事で、フェムト秒レーザーア ブレーション機構の解明と制御を行う予定 である。



図 8.本研究から得られた、閾値強度近傍での フェムト秒レーザーアブレーション過程の全 体像。

参考文献

 M Fujita and M. Hashida, J. Plasma Fusion Res. Vol. 81, Suppl. 195-201 (2005).
Hasegawa N. et al. Proceedings of SPIE 2011, 8140, 81400G-1 - 81400G-8 (2011).
S. Plimpton, Journal of Computational Physics, Vol. 69, pp. 40-42 (1972).

5. 主な発表論文等 〔雑誌論文〕(計15件)(全て査読あり) ① T. Kumada, M. Nishikino, 他 3 名 Dynamics of spallation during femtosecond laser ablation studied by time-resolved reflectivity with double pump pulses Applied. Physics Letters 108, 011102 (2016).② N. A. Inogamov, N. Hasegawa, 他18名 Hydrodynamics driven by ultrashort laser pulses and the optical pump X-ray probe experiment Applied Physics B 119, 413-419 (2015). ③ C. M. Kim, M. Nishikino, 他7名 Polarization of amplified spontaneous emission in a plasma active medium Phys. Rev. A, 92, 043807 (2015). ④ M. Ishino, 他 8 名 Low electron temperature in ablating materials formed by picosecond soft x-ray laser pulses Proc. of SPIE 9589, 958904-1-6 (2015). ⑤ Thanh-Hung Dinh, N. Hasegawa, 他 8 名 unresolved Temporal behavior of transition array emission in water window soft x-ray spectral region from multiply charged ions Appl. Phys. Lett. 107, 121101 (2015). ⑥ M. Ishino, 他 8 名 Very low electron temperature in warm dense matter formed by focused picosecond soft x-ray laser pulses Journal of Applied Physics 116, 183302 (2014).⑦ M. Baba, M. Nishikino, 他7名 Submicron scale image observation with a incidence grazing reflection-type single-shot soft X-ray microscope Japanese Journal of Applied Physics, 53, 080302-1-4 (2014). ⑧ <u>N. Hasegawa</u>,他 15 名 Observation of the laser-induced surface dynamics using the single-shot soft x-ray probe Springer Proc. in Phys, 147, pp. 117-120 (2014).(9) M. Nishikino, T. Kawachi X-ray laser plasma amplifiers Nature Photonics, 8, 352-354 (2014)

⑩ M. Ishino, 他13名

Nano-meter size modification of metal surfaces induced by soft x-ray laser pulse Springer Proc. in Phys, **147**, pp.121-124 (2014)

① J.Seres, <u>S. Namba</u>, 他 8 名 Parametric amplification of attosecond pulse trains at 11 nm SCIENTIFIC REPORTS **4**, pp. 04254-1-7 (2014)

① M. Ishino,他14名
Nano-meter size modification of metal surfaces induced by soft x-ray laser single pulse
Springer Proc. in Phys, 147, pp.121-124 (2014).
DOI 10.1007/978-3-319-00696-3_20

 M. Ishino,他15名
Nano-meter scale modifications on material surfaces induced by soft x-ray laser pulse irradiation
Proc. of SPIE 8849 88490F-1-8 (2013).

⑭ <u>M. Nishikino</u>, 他12名

Observation of the nano-scale surface dynamics of femtosecond laser ablation by time-resolved soft x-ray imaging technique

Proc. of SPIE 8849, 88490E-1-6 (2013).

① M. Nishikino,他7名
Development of Soft X-ray microscopy using
Fresnel Zone Plate for Observation of
Laser-Induce Surface Dynamics
Springer Proc. in Phys, 147, pp.117-120 (2013).

〔学会発表〕(計14件) ① <u>M. Nishikino</u> Source Development of Plasma-based Soft X-ray Laser and the Applications for Probing Nano-scale Dynamics of Laser Ablation

Compact EUV and X-ray Sources, Long Beach, USA, 2016.3.21.

 ② <u>錦野将元</u> X線レーザープローブを用いた fs レーザー 薄膜アブレーションの観測 レーザー学会・第 36 回年次大会、愛知県、 名古屋市、名城大学、2016 年 1 月 10 日(招 待講演).

③ <u>M. Nishikino</u> Observation of dynamics and modification of solid surface using a picosecond soft x-ray laser

SPIE Optical Engineering and Applications, San-Diego, USA, 2015.8.9. (招待講演).

④ M. Ishino Low electron temperature in ablating materials formed by picosecond soft x-ray laser pulses SPIE Optics + Photonics, San-Diego, USA, 2015.8.9. 5 <u>M. Ishino</u> Ablation Mechanism and Some Ideas of Applications of Modified Surface Structures Induced by Picosecond Soft X-Rav Laser. The 4th Advanced Lasers and Photon Sources (ALPS'15), 神奈川県, 横浜市, パシフィコ 横浜, 2015.4.22. 6 S. Namba Pump-Probe Spectroscopy for Temporal Characterization of Laser-Plasma XUV Pulses European Physical Society on Plasma Diagnostics, Frascati, Italia, 2015.4.14. ⑦ M. Nishikino Development of 0.1Hz SXRL beam lines and recent applications results COST-MP1203 WG5: High brightness and coherent X-ray sources for advanced spatial and temporal metrology, Jena, Germany, 2015.3.30. (招待講演). (8) N. Hasegawa A study of the femto-second laser ablation process in metals by using a soft x-ray laser probe PLASMA CONFERNCE 2014, 新潟県, 新潟市, 朱鷺メッセ, 2014.11.21 9 M. Nishikino Observation of Femtosecond Laser Ablation Tungsten by using Soft X-ray Laser PLASMA CONFERNCE 2014, 新潟県, 新潟市, 朱鷺メッセ, 2014.11.21 10 M. Ishino Investigation of interactions of soft x-ray laser pulses with matters 16th International Conference Laser Optics 2014 Saint-Petersburg, Russia, 2014.07.03. (1) M. Nishikino Observation of Weakly Excited Ablation Dynamics with Femtosecond Laser by using Time-Resolved Soft X-ray Imaging Technique The 14th International Conference on X-ray Lasers, Fort Collins, Colorado, USA, 2014.5.30. (招待講演).

① <u>M. Ishino</u>
Investigation of Optical Emission from the Surfaces Interacting with Soft X-Ray Laser Pulses
International Conference on HIGH ENERGY DENSITY SCIENCE 2014, 神奈川県, 横浜市, パシフィコ横浜, 2014.04.24.

13 <u>M. Nishikino</u>

Observation of the surface dynamics of femtosecond laser ablation by time-resolved soft x-ray imaging technique The 8th International Conference on Internal Fusion Science and Application, 奈良県, 奈良市, 新公会堂, 2013.09.08.

🛈 <u>N. Hasegawa</u>

A study of the femto-second laser ablation process in metals by using a single shot soft x-ray laser probe The 12th Asian Pacific Physics Conference, 千葉県, 千葉市, 幕張メッセ, 2013.07.18

6. 研究組織

(1)研究代表者
長谷川 登(HASEGAWA NOBORU)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構・原子力科学研究部門・量子ビーム応用研究センター・研究副主幹
研究者番号:50360409

(2)研究分担者

錦野 将元(NISHIKINO MASAHARU)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構・原子力科学研究部門・量子ビーム応用研究センター・研究副主幹
研究者番号: 70370450

石野 雅彦 (ISHINO MASAHIKO) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機 構・原子力科学研究部門・量子ビーム応用 研究センター・研究副主幹 研究者番号: 80360410

難波 慎一(NANBA SHINICHI)
広島大学・工学(系)研究科(研究院)・
教授
研究者番号: 00343294

大西 直文 (OHNISHI NAOFUMI)東北大学・工学研究科・准教授研究者番号: 20333859